

EV Group announces next-generation EVG150 resist processing platform – November 11, 2022

EVG announced that it has strengthened its portfolio of optical lithography solutions with the unveiling of the next-generation 200-mm version of its EVG®150 automated resist processing system. The redesigned EVG150 platform includes advanced features and enhancements that provide even greater throughput (by up to 80 percent) and versatility, as well as smaller tool footprint (by nearly 50 percent), compared to the previous-generation platform. The EVG150 provides reliable and high-quality coating and developing processes in a universal platform that supports a variety of devices and applications, including advanced packaging, MEMS, RF, 3D sensing, power electronics, and photonics.

◆ EV그룹, 차세대 EVG150 레지스트 처리 플랫폼 출시



MEMS 및 반도체 시장을 획이파 본딩 및 리소그래피 장비 업체인 EV Group(EVG)은 차세대 200mm EVG150 자동화 레지스트 처리 시스템을 출시한다고 지난 8일 밝혔다. EVG150은 이전 세대 플랫폼에 비해 최대 80% 높은 생산성, 우수한 병용성 등이 특징이다. 첨단 패키징, MEMS, RF, 3D 센싱, 전력 반도체, 포토닉스를 비롯한 다양한 디바이스 및 애플리케이션에 적용할 수 있다. EVG 측은 세계적인

EBS(electronic based system) 연구 센터인 일리본 오스트리아 랍스가 차세대 EVG150 시스템의 첫 번째 고객이라고 설명했다.

<https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=18642>